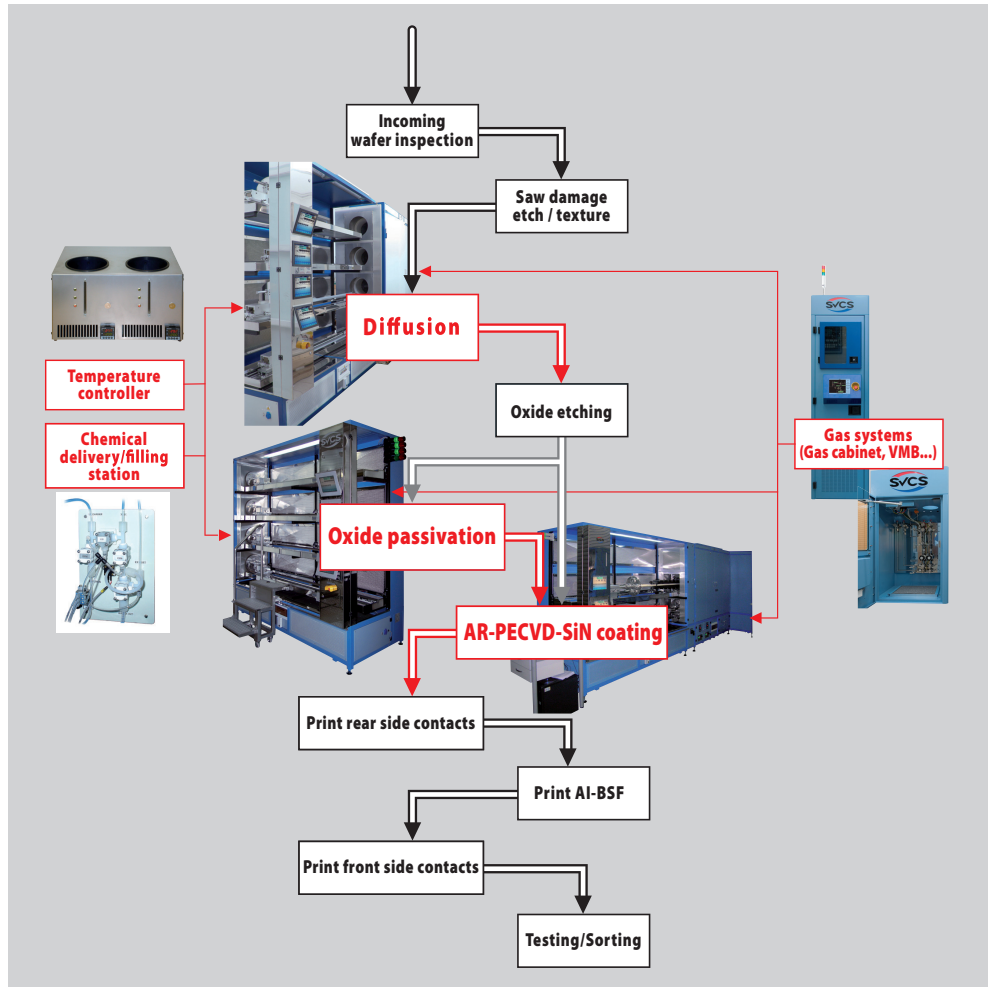


Güneş Hücresi Üretimi için Ekipmanlar

Yüksek Verimlilikte Güneş Hücreleri için Yarıiletken Kalite

GİRİŞ

SVCS yılların vermiş olduğu tecrübe ile güneş hücresi üretmek için yarıiletken sanayisinde kaliteli bir doğallık getirmektedir. SV SOL ailesi ürünleri fosfor veya boron katkılanması/ difüzyonu için yatay kesikli difüzyon fırınları, yansıma önleyici kaplamalar ve pasifleştirme için PECVD veya LPCVD yatay kesikli fırınlar, hem seri üretim hem de ARGE alanları için ultra yüksek saflıkta gaz ve sıvı dağıtım sistemleridir.



 - SVCS Ürünleri

EKIPMANLAR

- Fosfor/ Boron Katkılanması/ Difüzyon (POCl_3 , BBr_3 , vs.) için Yatay Difüzyon Fırınları
- SixNy yansıma önleyici kaplama ve pasifleştirme için Yatay PECVD Fırını
- Yüksek Saflıkta Gazlar için Otomatik/Manual Gaz Kabinleri (SiH_4 , NH_3 , O_2 , vs.)
- Birçok fırına ve/veya diğer ekipmanlara bağımsız Gaz/Sıvı hattı için Otomatik/Manual Valf Manifold Kutuları
- Fırın Gaz Verici Kapları için Otomatik Kontrol Aygıtları (POCl_3 / BBr_3 , vs.)
- Otomatik fırın gaz verici kaplarının yeniden doldurulması için Bulk Sıvısı Ortam İletimi
- Sulu/İslak Oksidasyon için Yatay Difüzyon Fırınları (pasifleştirme, emitör maskeleme ve üretim sistemindeki diğer talepler için)



SVCS Process Innovation s.r.o.
Head office:
 Optátova 37 • 637 00 Brno
 CZECH REPUBLIC
 Tel.: 420 541 423 211 • Fax: 541 221 580
 e-mail: info@svcs.eu • http://www.svcs.eu



SVCS CO.
 330 S Pineapple Ave. S-110
 Sarasota, Florida 34236, USA
 e-mail: info@svcspi.com
 http://www.svcspi.com



Testone Teknoloji Çözümleri
 Gursel Mah. İkbāl Sokak Testone Binası:7
 Kağıthane/İstanbul • TURKEY
 Tel: 444 83 78 • Faks: +90 (212) 222 9090
 email: semih@testone.com.tr
 http://www.testone.com.tr



Güneş Hücresi Üretimi için Ekipmanlar

FIRIN

Fırın Sistemleri

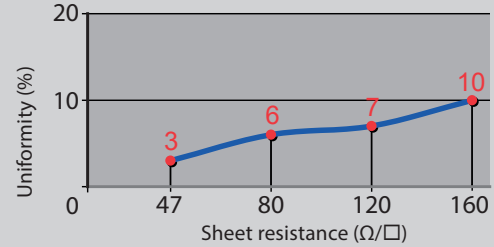
Wafer Boyutu : Kare standart 125 mm, 156 mm ve 210 mm (veya özel boyut)

	Difüzyon	PECVD	Islak Oksit	Islak Oksit
Wafer Yükleme/ Tüpü	500 (1 000)	200+	200+	200+
Ortalama Döngü Süresi	60+	40+	process dependent	process dependent

Uniformluk (minimum garanti)

On wafer (%)	3*	5	İşleme Bağı	İşleme Bağı
Wafer/Wafer (%)	3*	5	İşleme Bağı	İşleme Bağı
Run/Run (%)	3*	4	3	3
Yüzey Direnci ($\Omega/\square$)	40-160	Uygulanamaz	Uygulanamaz	Uygulanamaz
Tabaka Kalınlığı (nm)	Uygulanamaz	70-80	10...100	10...100
Büyütme Oranı, (nm/min)	Uygulanamaz	4	1...2	0,05...0,1

* Yüzey direnci için minimum uniformluk 47 $\Omega/\square$



Opsiyonlar:

Wafer Dağıtım Otomasyonu (Wafer Transfer Sistemi, Boat Asansörü, Stocker, vs.)

Gas Kabinleri ve Valf Manifold Kutuları

İşlem Gazları

SiH_4 , NH_3 , B_2H_6 , PH_3 , SiH_2Cl_2 , H_2 , Ar, O_2 , N_2O , N_2 , etc.

Aktarma Hızı

Boş olan gaz silindirleri dolu olan gaz silindiri ile otomatik olarak yer değiştirebilmektedir. Bu sayede Gaz Kabinleri düşük ve büyük miktarda gaz partiküllerini sürekli ve kesilmeden sağlayabilmektedir.

Sıcaklık Kontrol Cihazı

Isıtma/Soğutma

+50/-20 °C Göreceli Sıcaklıktan Ortam Sıcaklığına

Sıcaklık Kontrol Stabilesesi

0.1 °C

Stabilite Olma Zamanı

Maksimum 2 saat

Daha Detaylı bilgi için lütfen iletişime geçiniz.

GAZ KABİNLERİ

TSİCAKLİK KONTROL CİHAZI



EUROPEAN UNION
 EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND
 INVESTMENT IN YOUR FUTURE.